

研究評価委員会分科会の設置について

第25回研究評価委員会において、

研究評価委員会  
「マスク設計・描画・検査総合最適化技術開発」(事後評価) 分科会

が設置された。

表1. 研究評価委員会「マスク設計・描画・検査総合最適化技術開発」(事後評価)

分科会委員名簿

	氏名	所属、役職
分科会長	ほりうち としゆき 堀内 敏行	東京電機大学 工学部 機械工学科 教授
分科会長 代理	あさだ くにひろ 浅田 邦博	東京大学 大規模集積システム設計教育研究センター センター長/教授
委員	おのでら ひでとし 小野寺 秀俊	京都大学 大学院 情報学研究科 教授
	かめやま まさおみ 亀山 雅臣	社団法人 日本半導体製造装置協会 総務部兼技術部 部長
	しぶや まさと 渋谷 真人	東京工芸大学 工学部メディア画像学科 教授
	みやもと やすゆき 宮本 恭幸	東京工業大学 大学院理工学研究科 電子物理工学専攻 准教授

敬称略、五十音順